


Inwestor : Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMiF Zakład Technologii Mikrosystemów 05–500 PIASECZNO; ul. Okulickiego 5E							
OBIEKT : INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH 05–500 PIASECZNO; ul. Okulickiego 5E							
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis	Przerysowywanie, uzupełnianie, zastosowanie w innych opracowaniach wymaga zgody ANITEX GAZY TECHNICZNE wyrażonej pisemnie.		
Projektował	mgr inż. A. Surowiec		10.2020				
Opracował							
Sprawdził	mgr inż. J. Miedziński	instalacje sanitarne 1449/74/Kt					
Tytuł rysunku : REAKTOR PLAZMOWY typ ICP-CVD SENTECH INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH – schemat					Nr rysunku: 37.20–20.12	Format: A3	Rev: –
					Nr umowy: –	Stadium: projekt wykonawczy	Skala: –